

Title (en)
SINTERING DEVICE WITH SOURCE OF SHEARING FORCE, METHOD FOR PRODUCING AN ELECTRIC CONTACT MATERIAL USING THE SINTERING DEVICE, ELECTRIC CONTACT MATERIAL AND USE OF SAME

Title (de)
SINTER-VORRICHTUNG MIT SCHER-BELASTUNGS-QUELLE, VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ELEKTRISCHEN KONTAKT-WERKSTOFFS UNTER VERWENDUNG DER SINTER-VORRICHTUNG, ELEKTRISCHER KONTAKT-WERKSTOFF UND VERWENDUNG DES ELEKTRISCHEN KONTAKT-WERKSTOFFS

Title (fr)
DISPOSITIF DE FRITTAGE À SOURCE DE CHARGE DE CISAILLEMENT, PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE MATIÈRE DE CONTACT ÉLECTRIQUE À L'AIDE DU DISPOSITIF DE FRITTAGE, MATIÈRE DE CONTACT ÉLECTRIQUE ET UTILISATION DE LA MATIÈRE DE CONTACT ÉLECTRIQUE

Publication
EP 3702066 A1 20200902 (DE)

Application
EP 19160085 A 20190228

Priority
EP 19160085 A 20190228

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Sinter-Vorrichtung mit mindestens einer Sinter-Einheit zum Sintern von Sinter-Gut. Das Sinter-Gut weist Pulver-Partikel auf. Ausgestattet ist die Sinter-Einheit mit mindestens einem Sinter-Behälter zur Aufnahme des Sinter-Guts, mit mindestens einer Druck-Quelle zum Ausüben von Sinter-Druck auf das im Sinter-Behälter aufgenommene Sinter-Gut während des Sinterns, mit mindestens einer Strom-Quelle zum Einleiten von elektrischem Sinter-Strom während des Sinterns in den Sinter-Behälter und/oder in das im Sinter-Behälter aufgenommene Sinter-Gut und mit mindestens einer Sinter-Komponente für das Ausüben des Sinter-Drucks und für das Einleiten des elektrischen Sinter-Stroms. Dabei ist mindestens eine Scher-Belastungs-Quelle zum Aussetzen des im Sinter-Behälter aufgenommenen Sinter-Guts einer Scher-Belastung während des Sinterns vorhanden. Vorzugsweise weist die Scher-Belastungs-Quelle zumindest eine Rotations-Vorrichtung zum Rotieren des Sinter-Behälters und/oder zum Rotieren der Sinter-Komponente auf, so dass die Scher-Belastung während des Sinterns in das Sinter-Gut eingebracht werden kann. Mit dem Einbringen von der Scher-Belastung während des Sinterns resultiert ein zusätzlicher Freiheitsgrad für eine Form-Gebung des Sinter-Körpers mit dem Sinter-Gut. Neben der Sinter-Vorrichtung wird ein Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Kontakt-Werkstoffs unter Verwendung der Sinter-Vorrichtung angegeben, sowie ein auf diese Weise hergestellter elektrischer Kontakt-Werkstoff und dessen Verwendung für mindestens einen elektrischen Kontakt einer Mittelspannungs-Vakuum-Schaltrohre.

IPC 8 full level
B22F 3/03 (2006.01); **B22F 3/105** (2006.01); **B22F 3/14** (2006.01); **C22C 1/04** (2006.01); **C22C 9/00** (2006.01); **H01H 1/02** (2006.01); **H01H 33/664** (2006.01)

CPC (source: EP)
B22F 3/003 (2013.01); **B22F 3/105** (2013.01); **B22F 3/14** (2013.01); **B30B 11/027** (2013.01); **C22C 1/0425** (2013.01); **C22C 9/00** (2013.01); **H01H 1/0203** (2013.01); **H01H 1/0206** (2013.01); **H01H 11/048** (2013.01); **H01H 33/664** (2013.01); **B22F 2003/1051** (2013.01); **B22F 2999/00** (2013.01)

Citation (search report)
• [XY] WO 2018083325 A1 20180511 - UNIV PIERRE ET MARIE CURIE PARIS 6 [FR]
• [XA] US 6309591 B1 20011030 - YOO SANG H [US], et al
• [XA] US 6270718 B1 20010807 - YOO SANG H [US], et al
• [XAY] WO 2014202389 A1 20141224 - SIEMENS AG [DE]

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3702066 A1 20200902

DOCDB simple family (application)
EP 19160085 A 20190228